



応用物理学会 薄膜・表面物理分科会主催

協賛学会（予定）：日本表面真空学会、日本顕微鏡学会、ナノ学会、日本化学会、日本材料学会、電気化学会、日本分析化学会、日本分光学会、日本質量分析学会、日本放射光学会、日本物理学会、日本セラミックス協会、計測自動制御学会、表面分析研究会、研究基盤協議会

第 55 回薄膜・表面物理 基礎講座（2026）

表面・界面分析の原点回帰と進化

～ 最先端技術を正しく使いこなすための理論と実践 ～

日本において表面分析技術の開発・応用が本格化してから、およそ 60 年が経過しました。この間、材料研究・開発の高度化に伴い、表面・界面科学が扱う対象は飛躍的に広がり、多種多様な分析機器が普及するとともに、革新的な新手法の開発も目覚ましく進展しております。一方で、複雑化した表面・界面の性質を適切に評価するためには、個々の測定機器の特性を正しく把握し、目的に応じて最適な手法を選択する力が不可欠です。本年度の基礎講座では、表面・界面分析における「原点」となる基本原理を再整理するとともに、近年進展が著しい高度な解析プロセス、および最新の装置動向と活用のポイントを体系的に解説し、多くの研究者、技術者の方々の表面・界面評価の質をさらに高めることを目指します。

日時：2026 年 11 月 12 日（木） 9:45-17:20

場所：(株)島津製作所 Shimadzu Tokyo Innovation Plaza （対面開催）

https://www.shimadzu.co.jp/research_and_development/tokyo-innovation-plaza/

神奈川県川崎市川崎区殿町 3 丁目 25-40 京急大師線 小島新田駅より 徒歩 12 分

1. プログラム：（敬称略）

時間	講演テーマ	講師
9:45-9:50	開会	
9:50-10:35	日本の表面分析技術の歩み ～約 60 年にわたる技術開発～	尾張 真 (東大 名誉教授)
10:35-11:15	高度化された表面・界面の構造解析 における表面分析機器の役割	橋本 哲 (JFE テクノ)
11:15-11:55	先端計測機器硬 X 線光電子分光法 (HXPES の実体、役割)	上田 茂典 (NIMS)
11:55-13:10	休憩	
13:10-13:50	低エネルギー逆光電子分光 ～何が分かるのか、原理・応用～	吉田 弘幸 (千葉大)
13:50-14:30	大気圧光電子分光法の現状と応用	松田 巖 (東大)
14:30-15:10	二次イオン質量分析 ～技術はどこまで進んでいるか～	二宮 啓 (山梨大)
15:10-15:25	休憩	
15:25-16:05	先進的な走査電子顕微鏡の表面・界面 評価における役割	Dirk van der Wal (TESCAN GROUP)
16:05-16:45	測定データの利活用に向けて ～データ形式の標準化～	一村 信吾 (AIST 特別顧問)
16:45	閉会	
16:45-17:20	(株)島津製作所 Tokyo Innovation Plaza 見学（希望者：定員 48 名、 申込順）	

現在非会員の方でも、参加登録時に薄膜・表面物理分科会（年会費正会員：2,200 円（学生・院生：500 円）、準会員：

3,000 円（学生・院生：500 円））にご入会いただければ、本セミナーより会員扱いとさせていただきます。

<http://www.jsap.or.jp/> より入会登録を行い、会費支払及び仮会員番号を取得後、本セミナーにお申込み下さい。（年会費を基礎講座参加費と同時に振込なさらないで下さい。）

3. 定員：100 名（満員になり次第締め切ります。）

4. 参加申込期間： 2026 年 10 月 1 日 ～ 11 月 5 日（木）

5. 参加申込方法：下記 URL あるいは QR コードからイベントページのサイトにアクセスし、参加登録してください。

https://eventpay.jp/event_info?shop_code=1804158131583761&EventCode=C824791558

コンビニ支払い、ペイジー決済可。
原則として、参加費の払い戻し、
請求書の発行はできません。領収書
は申し込みサイトからダウンロード
可能です。



5. 参加費支払期限：2026 年 11 月 5 日（木）

6. 企画に関する問合せ先：第 55 回基礎講座企画担当

東京農工大 飯島善時 yijimamot@gmail.com

奈良先端大 武田さくら sakura@ms.naist.jp

7. 参加登録問合せ先：

応用物理学会事務局 分科会担当 岡本 普一

TEL：03-3828-7723

E-Mail：divisions@jsap.or.jp

8. 見学会・懇親会：

(株)島津製作所 Tokyo Innovation Plaza 見学会（最先端機器（SEM、XRD、MS など）の見学）を閉会後に実施します（無料）。見学会は希望者（定員 48 名）・申込順となります。希望者は参加登録時に、見学会申込にチェックを入れてください。見学会後に講師を囲む懇親会を開催予定です。

2. 参加費：テキスト代、消費税を含む

薄膜・表面物理 分科会会員*	応用物理学会会員** ・協賛学会会員	学生	その他
10,000 円	15,000 円	無料	25,000 円

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方は分科会会員扱いといたします。

**応用物理学会賛助会社の方は応用物理学会会員扱いといたします。